

# 離子減薄機(Precision Ion Polishing System)

## 一、系統規格及型號：

1. 機型：Gatan 691
2. 離子槍：Miniature Two Penning Ion Guns
3. 離子槍能量：1.5 KeV~ 6 KeV
4. 離子束減薄角度：+10° to -10°
5. 試片尺寸：3 mm (直徑)
6. 試片座旋轉速率：1 ~ 6 rpm
7. 離子源：Ar 氣體
8. Ion Current Density：10 mA/cm<sup>2</sup> Peak

## 二、系統外觀:



### 三、主要功能說明:

藉由離子束入射試片表面,去除 TEM 試片表面的雜質,同時減薄 TEM 試片厚度。

聯絡方式、收費標準及委託連結

#### ✓ 聯絡方式：

聯絡窗口	分機	Email	儀器位置
吳建霆	7682/7408	<a href="mailto:ctwu@narlabs.org.tw">ctwu@narlabs.org.tw</a>	R203

#### ✓ 收費標準：

設備編號	設備名稱	收費標準		
		自行操作 收費標準 (元/秒)	委託代工 收費標準 (元/小時)	備註
NM-005	離子減薄機	0.1	--	

註：委託代工時數未達半小時(30 分)者以半小時計。

#### ✓ 委託連結：

委託服務申請請至: [MES 系統](#) 及 [對外服務系統](#) 申請